© EPODOC / EPO

- PN -JP5223947 A 19930903
- TI METAL DETECTING APPARATUS
- FI -G01V3/10&F
- PA ANRITSU CORP
- IN ABE TAKASHI
- AP -JP19920056996 19920207
- PR -JP19920056996 19920207
- рт І

© PAJ / JPO

- PN -JP5223947 A 19930903
- TI METAL DETECTING APPARATUS
- -PURPOSE:To improve an yield rate by selecting material to be inspected, wherein metal is mixed among material to be measured, which is conveyed in a bulk state.
 - -CONSTITUTION: The alternating magnetic field, which is generated in a transmitting coil 14 toward a conveying path C of material to be inspected and received with two receiving coils 25 and 26 by equal amounts. The differential output signal is detected. The fact that the level of the detected output when the material to be inspected passes in the magnetic field exceeds a specified value is judged with a level judging means 32. When it is judged that the ON time of the judging signal exceeds the specified time, whether the detected output waveform is caused by the metal which singly passes in the magnetic field or not is judged with a waveform judging means 40. When the single passage is judged, the passing timing of the metal through the boundary position of two receiving coils 25 and 26 is detected based on the detected waveform. The delayed selected signal is outputted to a selecting apparatus 50 based on the detected timing.
 - -G01V3/10
- PA ANRITSU CORP
- IN -ABE TAKASHI
- ABD -19931209
- ABV -017669
- GR P1657
- AP -JP19920056996 19920207

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-223947

(43)公開日 平成5年(1993)9月3日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示簡所

G 0 1 V 3/10

F 7256-2G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平4-56996

(71)出顧人 000000572

アンリツ株式会社

平成4年(1992)2月7日

東京都港区南麻布5丁目10番27号

(72)発明者 阿部 俊

東京都港区南麻布五丁目10番27号 アンリ

ツ株式会社内

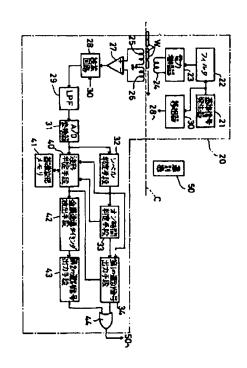
(74)代理人 弁理士 早川 誠志

(54) 【発明の名称】 金属検出装置

(57)【要約】

【目的】 パラ状に搬送される被検査体のうち、金属の 混入されている被検査体の選別を、歩留率を向上させ る。

【構成】 送信コイル24から被検査体の搬送路Cへ発生させた交番磁界を2つの受信コイル25、26で等量ずつ受け、その差動出力信号を検波する。被検査体が磁界中を通過するときの検波出力のレベルが所定値を越えたことが、レベル判定手段32によって判定され、その判定信号のオン時間が所定時間以上であると判定されると、このときの検波出力波形が、磁界中を単独に通過する全属によるものか否かが波形判定手段10で判定され、単独通過と判定された場合には、その金属が2つの受信コイル25、26の境界位置を通過するタイミングが、その検波波形から検出され、この検出タイミングに基づいて、遅延された選別信号が選別機50へ出力される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】被検査体の通過経路に磁界を発生する磁界 発生手段と、

被検査体が前記磁界中を通過するときの前記磁界の変化 を検出する磁界変化検出手段と、

前配磁界変化検出手段からの検出信号の大きさによって、被検査体に金属が混入しているか否かを判定するレベル判定手段と、

前記レベル判定手段で金属混入が判定されたときの前記 磁界変化検出手段の検出信号の波形が、前記磁界中を単独に通過する金属による波形であるか否かを判定する波 形判定手段と、

前記波形判定手段によって前記検出信号の波形が単独に 通過する金属による波形であると判定されたとき、該検 出信号の波形に基づいて、前記混入金属が前記磁界中の 所定位置を通過するタイミングを検出する金属通過タイ ミング検出手段とを具備した金属検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、被検査体の混入金属の 20 夕8の出力は反転しない。 有無を、混入金属による磁界変化を検出することによっ 【0013】ところが、(て判定する金属検出装置に関する。 検査体W。が受信コイル

[0002]

【従来の技術】食品等の生産ラインでは、製品を金属検出装置の検査磁界を通過させ、その磁界変化によって製品に混入される金属の有無をライン上で検査し、金属が混入している製品(以下、不良品と配す)を、後段の選別機でライン上から排除するようにしている。

【0003】一般に、金属検出装置と選別機とは別体で一定距離離れているため、金属検出装置で不良品と判定 30 された製品に対する選別信号を、その製品が選別機に到達するまで遅延する必要がある。

【0004】選別機は、ゲート板を搬送路へ移動させたり、エアを吹付けたりして製品の排除を行なうが、不良品を確実に排除するためには、製品の大きさ等に応じた適切な選別時間が必要となる。

【0005】通常、選別機は製品の種類に合ったものを 選んで用いるため、金属検出装置側に選別信号の遅延手 段や選別時間を決定する手段を設けている。

【0006】そして、金属検出装置は、不良品が金属検 40 出装置を通過したタイミングを投受光器で検出し、この 製品に対応した時間幅の選別信号を、投受光器から選別 機までの距離とライン速度に対応した時間だけ遅延させ て選別機へ出力している。

【0007】しかして、製品が大型でしかも適切な間隔で搬送される場合には、投受光器による製品個々の通過タイミングが確定できるが、パラ状態で不定間隔に搬送される小型な製品(例えばウィンナソーセージやキャラメル等)を検査する場合、製品同士が重なった状態や連続した状態で全層輸出装置を通過するため、投票と思す

製品個々の通過タイミングを確定することはできない。

【0008】このため、このようなパラ状態の製品を検査する金属検出装置では、混入金属が検査磁界に与える影響を示す信号によって、選別信号の出力タイミングを決定せざる得ない。

【0009】図4は、上記のようなパラ状の被検査体の 金属混入を検査するための従来の金属検出装置1を示し ている。

【0010】この金属検出装置1は、信号発生器2から 10 の正弦波信号で送信コイル3を励磁し、被検査体の搬送 路Cへ交番磁界(検査磁界)を発生させ、その磁界を搬 送路に沿って並んだ2つの受信コイル4、5で等量ずつ 受ける。

【0011】受信コイル4、5に誘起される交流信号は、差動増幅器6に入力され、その差動出力は、検波回路7によって検波される。検波回路7の検波出力はコンパレータ8で基準電圧Vrと比較される。

【0012】磁界中に被検査体Wがない状態では、差動 出力は零であるため、検液出力も零となり、コンパレー タ8の出力は反転しない。

【0013】ところが、例えば鉄の混入金属mを含む被検査体W。が受信コイル4に近づくと、混入金属mによって一方の受信コイル4側の磁束密度が大となり、他方の受信コイル5側の磁束密度が小となる。この被検査体W。が他方の受信コイル5上まで搬送されると、受信コイル5側の磁束密度が大となり、受信コイル4側の磁束密度が小となる。

【0014】このため、検波出力は被検査体W。の磁界 通過にともなって図5の(a)に示すように変化し、コ ンパレータ8からは、同図の(b)に示すように混入金 属有りを示すHレベルの判定信号が選別信号出力手段9 へ出力される。

【0015】なお、金属が磁界に与える影響はその金属が大きい程早い時期に表われる(図5の(a)の点線の波形)ため、この大きな金属を含む被検査体の近傍に他の被検査体内の小さな金属があった場合、その小さな金属を判定信号から識別できない。

【0016】このため、選別信号出力手段9は、判定信号の立上りを基準タイミングとし、同図の(c)に示すように、この基準タイミングから所定時間Ta遅れたタイミングに立上り、被検査体の排除に最低限必要な時間Teと判定信号のオン時間To」との加算時間だけHレベルとなる選別信号を、選別機10へ出力している。なお、時間Taは、例えば磁界中心位置から選別機10までの距離1を搬送速度Vで除算した値を減じた時間に予め設定しておく。

される小型な製品(例えばウィンナソーセージやキャラ 【0017】このようにしておけば、混入金属が磁界に メル等)を検査する場合、製品同士が重なった状態や連 与える影響が大きい程、即ち、判定信号のオン時間が長 続した状態で金属検出装置を通過するため、投受光器で 50 い程、早期にそして長い時間排除が行なわれ、大きな金 3

属の影響によって識別できない小さな金属を含む被検査 体も、余裕をもって選別機10で確実に排除することが できる。

[0018]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の ような従来の金属検出装置では、大きな金属の混入して いる1つの被検査体が、金属を含まない多数の被検査体 (良品) とともに磁界中をほぼ同時に通過した場合、こ れら多数 (例えば数10個) の良品も選別機で同時に排 除されてしまうため、歩留率が低く、排除品の中から不 10 良品のみを選別する作業(排除品を充分間隔をとりなが ら再投入する作業)が長時間必要になってしまう。

【0019】本発明は、この課題を解決し、確実な選別 が行なえ、しかも歩留率を向上させた金属検出装置を提 供することを目的としている。

[0020]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、本発明の金属検出装置は、被検査体の通過経路に磁 界を発生する磁界発生手段と、被検査体が前記磁界中を 通過するときの前記磁界の変化を検出する磁界変化検出 20 手段と、前記磁界変化検出手段からの検出信号の大きさ によって、被検査体に金属が混入しているか否かを判定 するレベル判定手段と、前記レベル判定手段で金属混入 が判定されたときの前記磁界変化検出手段の検出信号の 波形が、前記磁界中を単独に通過する金属による波形で あるか否かを判定する波形判定手段と、前記波形判定手 段によって前記検出信号の波形が単独に通過する金属に よる波形であると判定されたとき、該検出信号の波形に 基づいて、前記混入金属が前記磁界中の所定位置を通過 とを備えている。

[0021]

【作用】このように構成したため、本発明の金属検出装 置では、磁界発生手段によって発生する磁界中を、金属 が混入された被検査体が通過すると、この金属による磁 界の変化に対応した検出信号が磁界変化検出手段から出 力され、レベル判定手段によって金属の混入が判定され る。金属の混入が判定されると、そのときの検出信号の 波形が、磁界中を単独に通過した金属による波形である か否かが判定され、単独通過の場合には、その波形から 金属が磁界中の所定位置を通過したタイミングが検出さ れる。

[0022]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の一実施例を説

【0023】図1は、一実施例の金属検出装置20の構 成を示す図である。この金属検出装置20の磁界発生手 段は、基準信号発生器21から出力される所定周波数の 矩形波信号をフィルタ22によって正弦波に変換し、こ の正弦波を電力増幅器23で増幅して送信コイル24を 50 41に予め記憶されている基準波形とを比較する。

励磁し、被検査体Wの搬送路Cへ交番磁界を発生してい

【0024】この交番磁界の金属通過による変化を検出 するための磁界変化検出手段は、その搬送路Cに沿って 交番磁界を等しく受ける位置に並んだ2つの受信コイル 25、26と、両受信コイル25、26の出力を差動増 幅する差動増幅器27と、その差動出力を検波する検波 回路28とLPF(低域通過フィルタ)29によって構 成されている。

【0025】一方、基準信号発生器21からの矩形波信 号は、移相器30へ入力されており、この移相器30で 所定位相遅延された矩形波信号は、検波回路28へ入力 されている。検波回路28は、移相器30からの矩形波 信号によって差動増幅器27の出力を同期検波する。

【0026】なお、移相器30による位相遅延量は、金 属が混入していない被検査体(以下、良品と配す)が磁 界中を通過する際の検波出力が最小となるように、予め 決められている。このため、良品通過時の検波出力は、 無視できる極めて小さいレベルになっている。

【0027】検波回路28の出力信号は、低域通過フィ ルタ29によって、搬送波成分(基準信号発生器21の 出力周波数成分) が除去され、A/D変換器31に入力 される。

【0028】A/D変換器31は、検波出力を高速にサ ンプリングして、各サンプリング値に対応したディジタ ル信号を出力する。

【0029】A/D変換器31からのディジタル信号 は、レベル判定手段32へ入力されている。

【0030】レベル判定手段32は、図2に示すように するタイミングを検出する金属通過タイミング検出手段 30 検波出力信号(a)が所定の基準値Vrを越えている 間、金属の混入を示す判定信号(b)を出力する。

> 【0031】オン時間判定手段33は、レベル判定手段 3 2 からの判定信号のオン時間 Ton を検出して、第1の 選別信号出力手段34へ出力するとともに、このオン時 間Tonと所定時間Trとを比較し、TonがTrより小の ときには、後述する波形判定手段40をリセットする (なお、この時間検出はA/D変換のサンプリング周期 に基づいてなされている)。

【0032】第1の選別信号出力手段34は、前述した 40 従来装置の選別信号出力手段と同様に、判定信号の立上 りから所定時間Ta (Ta=L/V-Lw/V)後に、 判定信号のオン時間Tomと所定時間Te との加算時間だ け選別信号を出力する(Teは1つの被検査体を排除す るのに最低限必要な時間で、例えば2Lw/V)。

【0033】波形判定手段40は、A/D変換器31か ら出力される検波出力を、図2に示すように、レベル判 定手段32の判定信号の立上り時から所定期間Th(例 えばTh=2Ton)だけ波形データとして記憶した後、 この記憶した検波出力の波形データと、基準波形メモリ

5

【0034】基準波形メモリ41には、判定信号のTon 時間がTr時間以上となる複数種類の基準波形データが 配憶されている。

【0035】これらの基準波形データは、大きさの異な る複数の金属を複数の被検査体に1個ずつ混入させた撥 似不良品を、1つずつ単独に磁界中へ通過させたときの 検波出力データであって、各基準波形データは、それぞ れのTon時間に対応づけて配憶されている。

【0036】波形判定手段40は、判定信号のオン時間 Tunに最も近い基準波形データを読出して検波出力波形 と比較し、その差が所定値以内であれば、検波出力の波 形が、磁界中を単独に通過する金属によるものであると 判定して、第1の選別信号出力手段34をリセットす

【0037】また、この波形判定手段40は、TonがT rより小の場合、オン時間判定手段33からのリセット により、検波出力波形の配憶を停止して、それまでの記 憶値をリセットする。

【0038】金属通過タイミング算出手段42は、波形 判定手段40によって検波出力波形が単独に通過する金 属によるものと判定されたとき、図2に示すように検波 出力波形の+側ピークP: と-側ピークP: との中間時 点t。から現時点(判定信号の立上りからTh時間経過 時点)までの時間Tsを算出する。この中間時点は、単 独に通過する金属が、2つの受信コイル25、26の境 界位置に達するタイミングである。

【0039】金属通過タイミング検出手段42は、この 境界位置から、選別機50までの距離しを搬送速度Vで 除した値L/Vから、最低限必要な選別時間Teの1/ 2と算出時間Tsとを減じた結果、即ち、

Td = (L/V) - Ts - Te/2

を、遅延設定時間として第2の選別信号出力手段43へ

【0040】第2の選別信号出力手段42は、この遅延 設定時間Tdを受けてから、そのTd時間後に選別信号 をTe時間出力する。

【0041】第1、第2の選別信号出力手段34、43 の出力はオア回路44を介して選別機50へ出力されて いる。

【0042】選別機50は、第1または第2の選別信号 出力手段34、43から選別信号が出力されている間、 搬送路上の被検査体を例えばエア吹付けによって搬送路 上から排除する。

【0043】このように構成された金属検出装置の磁界 内にウィンナソーセージ等の被検査体がパラ状で進入 し、その中の1つに小さな金属が混入していると、検波 出力は、図3の(a)に示すように、ti時に基準値V rを越える。

【0044】このため、同図の(b)のようにt1時に

る。この判定信号のオン時間Toxiは、所定時間Trよ り短かいため、波形判定手段40はリセットされ、同図 の(c)に示すように、t1時点からTa時間経過した 後(tz時)に、第1の選別信号出力手段34からTe + Ton1 時間だけ選別信号が出力される。この選別信号 は、オア回路44を介して選別機50に出力され、tx 時からta 時までの間エア吹付けによる被検査体の排除 がなされ、不良品は搬送路上から排除される。

6

【0045】この排除期間は、必要最低限の排除時間T eに、短かいToxi 時間を加えたものであるため、不良 品とともに排除される良品は少なくて済む。

【0046】また、大きな金属が混入している被検査体 が良品とともに磁界内に進入して、同図の(a)に示す ような正弦状の大きな検波信号が出力されると、レベル 判定手段32からはTrを越えるオン時間Tong の判定 信号が、ta 時に出力される。

【0047】このため、波形判定手段40は、リセット されずに、ta 時からTh (=2 Toxz) 時間の検波出 力を記憶し、この記憶データと、Tong 時間に対応した 20 基準波形データとを比較する。この場合の波形は単独に 通過する金属によるものであるから、その波形の差は所 定の誤差範囲内と判定されて、単独金属が通過したこと を示す信号が、金属通過タイミング検出手段42へ出力 されるとともに、第1の選別信号出力回路34の遅延動 作はリセットされる。

【0048】金属通過タイミング検出手段42は、単独 金属の通過を示す信号を受けると、波形判定手段40に 記憶されている検波出力波形のピーク点P:、P2間の 中間時点(ts時)から現時点(ts時)までの時間T 30 11を算出する。

【0049】このt。時点は、混入金属が2つの受信コ イル25、26の境界位置を通過するタイミングである ため、この金属が t。 時点から選別機50に達するまで のタイミングTmは、

 $Tm = L/V - T_{s1}$

となる。

【0050】金属通過タイミング検出手段42は、金属 の混入している被検査体を確実に排除するために最低限 必要な排除時間Teの1/2をTmから減じ、その結果 を遅延時間Tdとして出力する。

【0051】このため、第2の選別信号出力手段43か らは、図3の(d)のように、ta時からTd時間後の t, 時に、選別信号がTe時間出力される。この選別信 号はオア回路44を介して選別機50へ出力されるた め、この大きな金属の混入している被検査体は、確実に 搬送路から排除される。なお、この排除期間中に選別機 50を通過しようとする良品も排除されるが、その数 は、排除期間が短かいため、数個程で済む。

【0052】なお、図3の(a)の最後の検波出力波形 立上がる判定信号がレベル判定手段32から出力され 50 のように、単独金属による基準被形と大きく異なり、オ

ン時間Tona がTrを越える場合には、波形判定手段4 0からは単独金属の通過を示す信号が出力されないた め、第1の選別信号出力手段34によって、判定信号の 立上り時t。時からTa時間後のt。時に、Te+T osa 時間だけ選別信号が出力される。

【0053】なお、前記実施例では、被検査体を交番磁 界中に通過させていたが、永久磁石等による静磁界や脈 流磁界を用いた金属検出装置にも本発明を同様に適用で きる。

【0054】また、前配実施例のように、2つの受信コ 10 イル25、26を同一面に並べて送信コイル24に対向 させる対向形式のものだけでなく、2つの受信コイルを 送信コイルの両側に同軸状に配置した同軸形式のもの や、コイルでない磁気センサを用いたもの等についても 同様に適用できる。

【0055】また、前記実施例のレベル判定手段32 は、検波出力の+側が基準値Vrを越えるか否かを判定 していたが、混入金属が鉄金属あるいは非鉄金属のいず れにも対応できるように、検波出力の+側と-側とを区 別なく判定するようにしてもよい。

【0056】また、前記実施例では、予め基準波形メモ リ41に各オン時間に対応した複数の基準波形を記憶し ておき、検波波形と基準波形とを比較するようにしてい たが、大きな金属が混入している場合の検波波形は、ほ ぼ正弦波に近似できるので、検波波形自身が正弦波に近 いか否かを判別するようにしてもよい。また、前記実施 例では、判定信号のオン時間が所定時間Tr以上のとき に、検波信号の波形を判定していたが、オン時間の長さ にかかわらず、検波出力の波形の判定のみによって、選 別信号の遅延時間や選別時間を切り換えるようにしても 30 40 波形判定手段 よい。

[0057]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の金属検出

装置は、被検査体が磁界中を通過する際の磁界変化に対 応した検出信号の波形が、磁界中を単独に通過する混入 金属によるものか否かを判定して、その混入金属の位置 を識別できるように構成されているため、この混入金属 が所定の選別位置に達するタイミングを正確に把握で き、多数の良品をこの不良品とともに、排除しないで済 み、歩留りを激減することができ、排除品の再検査を短 時間で行なうことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例の構成を示すプロック図であ

【図2】一実施例の要部の動作を説明するための信号図 である。

【図3】一実施例の各部の動作を説明するためのタイミ ング図である。

【図4】 従来装置の構成を示すプロック図である。

【図5】従来装置の動作を示すタイミング図である。 【符号の説明】

20 金属検出装置

20 21 基準信号発生器

24 送信コイル

25、26 受信コイル

27 差動增幅器

28 検波回路

30 移相器

31 A/D変換器

32 レベル判定手段

33 オン時間判定手段

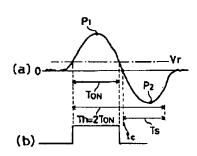
34 第1の選別信号出力手段

41 基準波形メモリ

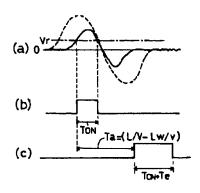
42 金属通過タイミング検出手段

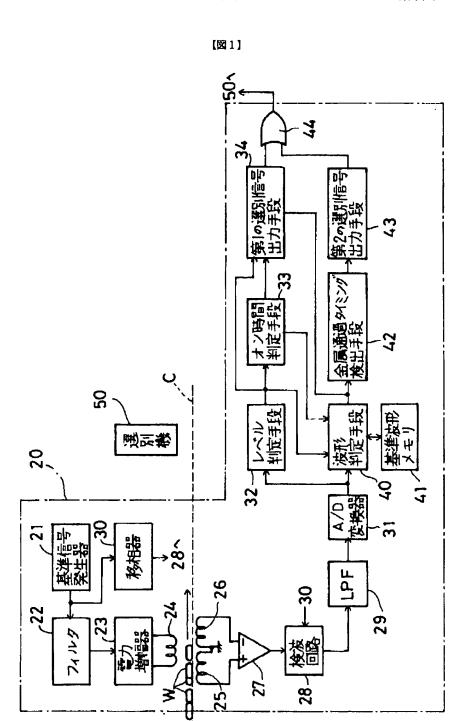
43 第2の選別信号出力手段

[図2]



[図5]





【図3】

